



FPD露光装置

FX-6AS

第6世代プレートサイズ対応

最高水準の高解像度を実現したFPD露光装置



第6世代プレートサイズ対応 最高水準の高解像度を実現したFPD露光装置

FPD露光装置 FX-6AS

第6世代プレートによる最先端高精細中小型パネルの生産に対応。新開発の投影レンズを搭載し、位相シフトマスク使用時1.0 μm という最高水準の高解像度と生産性向上、高い重ね合わせ精度を同時に実現しました。

特長

- マルチレンズシステムを搭載**
複数の投影レンズで構成されたマルチレンズシステムを搭載。広い露光領域を確保すると同時に、高解像度を達成。
- 高解像度**
従来機をさらに進化させた高NAの投影レンズを新規開発。光源には量産プロセスで実績のあるi線を採用し、FX-68SH/68Sで開発した画期的なフォーカス補正システムを搭載。これらにより第6世代プレート全面において高い線幅均一性を確保しつつ、位相シフトマスク使用時で1.0 μm (L/S)の量産を実現。
- 高い重ね合わせ精度**
従来機で実績のある高精度な計測と位置制御性能を継承しつつ、収差を抑えた新開発投影レンズとの組み合わせにより、高い重ね合わせ精度を実現。
- 高スループット**
1.0 μm^* の高解像度を従来機と同じ露光領域で達成。第6世代プレートで4スキャンを可能とするとともに、照明システムの最適化による照度向上によって高スループット(毎時85プレート)を実現。
- 安定した露光性能**
従来機で実績のあるさまざまなキャリブレーション機能を適用し、稼働中の安定した露光性能を実現。

Performance

解像度 (L/S)	1.0 μm^* (i-line)
投影倍率	1:1
重ね合わせ精度	$\leq \pm 0.23 \mu\text{m}$
プレートサイズ	1,500 mm \times 1,850 mm
タクトタイム	42 s/plate Conditions: 1,500 mm \times 1,850 mm, 4 scans, i-line, 30 mJ/cm ²

*1 位相シフトマスク使用時

レーザ光

ビームをのぞきこまないこと

Max. 1 mW CW He-Ne 633 nm

クラス2 レーザ製品



安全に関するご注意

■ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

ご注意

本カタログに掲載した製品および製品の技術（ソフトウェアを含む）は「外国為替および外国貿易法」に定める規制貨物等（特定技術を含む）に該当します。輸出する場合には政府許可取得等適正な手続きをお取りください。

・このカタログは2024年7月現在のものです。仕様と製品は、製造者側がなんら債務を被ることなく予告なしに変更されます。

・このカタログに掲載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

©2024 NIKON CORPORATION

株式会社 **ニコン**

精機事業本部 商品戦略部 140-8601 東京都品川区西大井1-5-20 電話(03)6743-5533

株式会社 **ニコンテック** 140-0012 東京都品川区勝島1-5-21 東神ビル 電話(03)5762-8911

<https://fpd.nikon.com/>